

Сумський державний університет
СЕМЕСТРОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
8.171 ЕЛЕКТРОНІКА

рік прийому - 2018

денна форма навчання

Освітньо-наукова програма

2 -й семестр

2018/2019 навчальний рік

| № п/п | Назва навчальної дисципліни | Форма звітності | | | | | Загальний обсяг | | СРС год. | Всього ауд., год. | Навчальна робота за семестр, год. | | | | | | Розподіл навчальної роботи студента за мод. циклами (год. на тиждень) | | | | | | | | | | | Кафедра | Потік | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|---------|-----|-----|------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|----|-----|-----|---|---------------|----|----|----|-----|------|---|--|--|--|---------|-------|------|-------------|
| | | іс-пит | д/залік | ІДЗ | | | годин | кредитів | | | III (8 тижнів) | | | | | | 1 т. | IV (8 тижнів) | | | | | 1 т. | | | | | | | | |
| | | | | мод | вид | кількість | | | | | Ауд. | Лк | Пр | Лб | ІРС | КзР | А | Ауд. | Лк | Пр | Лб | ІРС | КзР | А | | | | | | | |
| НОРМАТИВНА ЧАСТИНА | | | | | | | | | | 660 | 22,0 | 500 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПП | Цикл професійної та практичної підготовки | | | | | 660 | 22,0 | 500 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Науково-дослідна робота | | зах | | | 150 | 5,0 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | |
| 2 | Організаційно-технічний супровід кар'єри спеціаліста високотехнологічної індустрії | | д/з | | | 150 | 5,0 | 118 | 32 | 16 | 16 | | | 8 | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | Електроніка |
| ВБ1.00. | 8.171.00.09Електронні інформаційні системи | | | | | 360 | 12,0 | 232 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні | дск | | | | 120 | 4,0 | 72 | 48 | 32 | 16 | | | 8 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | |
| 3.1 | Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні - КР | | зах | | | 30 | 1,0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | |
| 4 | Основи мікроелектроніки | | д/з | | | 60 | 2,0 | 44 | 16 | 16 | | | | 8 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | |
| 5 | Фізичні основи наноелектроніки та спінтроніки | | д/з | | | 150 | 5,0 | 86 | 64 | 48 | 16 | | | 8 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | |
| ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА | | | | | | 300 | 10,0 | 204 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПП | Цикл професійної та практичної підготовки | | | | | 300 | 10,0 | 204 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВБ1.00. | 8.171.00.09-01Вибірковий блок 1 | | | | | 300 | 10,0 | 204 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мікроелектронні сенсори | дск | | | | 150 | 5,0 | 86 | 64 | 32 | 32 | | | 8 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | |
| 2 | Матеріалознавство наноелектроніки | | д/з | | | 150 | 5,0 | 118 | 32 | 16 | 16 | | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | ЕЗПФ | |

| № п/п | Назва навчальної дисципліни | Форма звітності | | | Загаль- ний обсяг | | СРС год. | Всь- ого ауд., год. | Навчальна робота за семестр, год. | | | | | | Розподіл навчальної роботи студента за мод. циклами (год. на тиждень) | | | | | | | | | | | Кафедра | Потік | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------|-----|----------------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|---------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------|--|
| | | іс- пит | д/ за- лік | ІДЗ | | | | | го- дин | кре- дитів | III (8 тижнів) | | | | | | 1 т. | IV (8 тижнів) | | | | | | 1 т. | | | | | | | |
| | | | | мод | вид | кіль- кість | | | | | Ауд. | Лк | Пр | Лб | ІРС | КзР | А | Ауд. | Лк | Пр | Лб | ІРС | КзР | А | | | | | | | |
| ВБ2.00. | 8.171.00.09-02Вибірковий блок 2 | | | | | 300 | 10,0 | 204 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Багатофункціональні сенсори | дск | | | | 150 | 5,0 | 86 | 64 | 32 | 32 | | | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | | | 0,5 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 0,5 | 2 | ЕЗПФ | |
| 2 | Основи волоконної оптики та голографії | | д/з | | | 150 | 5,0 | 118 | 32 | 16 | 16 | | | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | ЕЗПФ | | |
| | Всього за семестр | 2 | 6 | | | 960 | 32,0 | 704 | 256 | 160 | 96 | 0 | 0 | 56 | 20 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3,5 | 10 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3,5 | 10 | | |

Начальник НМВ

_____ О.А.Криклій

Декан факультету
